公開番号 又は 特許番号	特開 2014-118307
発明名称	半導体粒子の製造方法及び製造装置
出願人 又は 権利者	三菱電機株式会社
想定デバイス	シート型健康管理デバイス、アンビエントデバイス、エネルギーハーベスティング
要約	<p>【利用分野】 粒径分布が少ない μm からサブ μm の大きさで、回収率の高い高純度シリコン粒子を得ること。</p> <p>【発明の内容】 水素を含有する反応ガス雰囲気中で、基板 10 と固体シリコンからなるターゲット 11 の間に放電を生起させて基板 10 上にシリコンを堆積する大気圧プラズマ化学輸送法において、反応ガスはシランを含有せず、放電は超短波の高周波電源 4 を用いて生起され、基板 10 はプラズマ P に曝されても基板 10 表面で化学的な反応を生じにくい材料からなる基板を用いる。</p>
図面	